МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО"

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
на 2024/2025 навчальний рік, прийому студентів 2024 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з навчальної роботи

_____ Анатолій МЕЛЬНИЧЕНКО
"___"_____ 2024 р.

Спеціальність	176 Мікро- та наносистемна техніка	Факультет/ННІ	Факультет електроніки
Освітня програма	Мікро- та наноелектроніка	Форма здобуття вищої освіти	*Очна (денна)*
Освітній ступінь	магістра	Строк навчання	1 рік 4 місяці
Випускова кафедра	*Кафедра мікроелектроніки*	Кваліфікація	Магістр з мікро- та наносистемної техніки

№ п/п	Освітні компоненти (навчальні дисц., курс. пр.(роб.), практ., кваліф. роб.)	Кафедра	К-ть здобув.		Обсяг дисциплін		Аудиторні години								СРС	Контрольні заходи								Розподіл аудиторних годин на тиждень за курсами і семестрами							
								Лекції		Практ. (комп. прк)		Лабор												1 курс							
																								ДП-41мп (Б: 7, К: 0);							
																								1 семестр				2 семестр			
																								18 тижнів				18 тижнів			
			Бюджет	Контракт	Кред ECTS	Години	Всього	за НП	з урах. Інд занять	за НП	з урах. Інд занять	за НП	з урах. Інд занять	Інд. зан.		Екзамени	Заліки	МКР	Курсові роботи	Курсові проекти	РГР,РР,ГР	ДКР	Реф.	Всього	у т.ч. Лекц	Практ	Лаб	Всього	у т.ч. Лекц	Практ	Лаб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1. НОРМАТИВНІ освітні компоненти																															
Цикл загальної підготовки																															
1	*Інтелектуальна власність та патентознавство (модуль Патентознавство та набуття прав)*	КМ	7	0	2.0	60	36	24	-	12	-	-	-	0	24		2	2										2	1.33	0.67	
2	*Інтелектуальна власність та патентознавство (модуль Право інтелектуальної власності)*	КІВПП	7	0	1.0	30	18	12	-	6	-	-	-	0	12													1	0.67	0.33	
3	*Foundations of sustainable development (Основи сталого розвитку)*	ШІ	7	0	2.0	60	36	18	-	18	-	-	-	0	24		2	2										2	1	1	
4	*Практичний курс іноземної мови для ділової комунікації*	АМТС1	7	0	3	90	72	-	-	72	-	-	-	0	18		2	1						2		2		2		2	
5	*Менеджмент стартап проектів*	МП	7	0	3.0	90	54	18	-	36	-	-	-	0	36		1							3	1	2					
Разом нормативних ОК циклу загальної підготовки					11	330	216	72	0	144	0	0	0	0	114	0	4	3	0	0	0	0	0	5	1	4	0	7	3	4	0
Цикл професійної підготовки																															
6	*Наноматеріали та нанотехнології*	МЕ	7	0	5.0	150	72	36	-	36	-	-	-	0	78	1		1				1		4	2	2					
7	*Прилади на нанорозмірних та квантових ефектах*	МЕ	7	0	4.0	120	72	36	-	36	-	-	-	0	48		1	1			1			4	2	2					
8	*Електронні сенсори*	МЕ	7	0	5.0	150	72	36	-	-	-	36	-	0	78	1		1					1	4	2		2				
9	*Проектування напівпровідникових приладів та інтегральних мікросхем*	МЕ	7	0	5.0	150	72	36	-	36	-	-	-	0	78	1		1						4	2	2					
10	*Проектування напівпровідникових приладів та інтегральних мікросхем. Курсовий проєкт*	МЕ	7	0	1.0	30	0	-	-	-	-	-	-	0	30		1			1											
11	*Фізико-хімія поверхні*	МЕ	7	0	4.0	120	54	36	-	18	-	-	-	0	66		1	1					1	3	2	1					
12	*Основи наукової та педагогічної діяльності*	МЕ	7	0	4.0	120	36	18	-	18	-	-	-	0	84		1					1		2	1	1					
Разом нормативних ОК циклу професійної підготовки					28	840	378	198	0	144	0	36	0	0	462	3	4	5	0	1	1	2	2	21	11	8	2	0	0	0	0
ВСЬОГО НОРМАТИВНИХ					39	1170	594	270	0	288	0	36	0	0	576	3	8	8	0	1	1	2	2	26	12	12	2	7	3	4	0
2. ВИБІРКОВІ освітні компоненти																															
Вибіркові освітні компоненти з міжфакультетського/факультетського/кафедрального Ф-каталогів																															
13	*Моделювання технологій та приладів наноелектроніки*	МЕ	7	0	5.0	150	72	36	-	36	-	-	-	0	78	2		2			2							4	2	2	
14	*Системи обробки сигналів*	МЕ	0	0	5.0	150	72	36	-	36	-	-	-	0	78	2		2			2							4	2	2	
15	*Кристалохімічні основи технології наноструктур*	МЕ	7	0	5.0	150	72	36	-	36	-	-	-	0	78	2		2			2							4	2	2	
16	*Системи перетворення сигналів*	МЕ	0	0	5.0	150	72	36	-	36	-	-	-	0	78	2		2			2							4	2	2	
17	*Проєктування аналогових інтегральних схем*	МЕ	7	0	5.0	150	72	36	-	36	-	-	-	0	78	2		2			2							4	2	2	
18	*Design of analog integrated circuits*	МЕ	0	0	5.0	150	72	36	-	36	-	-	-	0	78	2		2			2							4	2	2	
19	*Бездротові сенсорні мережі*	МЕ	0	0	5.0	150	72	36	-	36	-	-	-	0	78	2		2			2							4	2	2	
20	*Системи обробки цифрової інформації*	МЕ	0	0	4.0	120	54	36	-	18	-	-	-	0	66		2	2					2					3	2	1	
21	*Спецкурс мікро- та наносистемної техніки*	МЕ	7	0	4.0	120	54	36	-	18	-	-	-	0	66		2	2					2					3	2	1	
22	*Special course of micro- and nanosystem technology*	МЕ	0	0	4.0	120	54	36	-	18	-	-	-	0	66		2	2					2					3	2	1	
23	*Фотоніка*	МЕ	7	0	4.0	120	54	36	-	18	-	-	-	0	66		2	2					2					3	2	1	
24	*Photonics*	МЕ	0	0	4.0	120	54	36	-	18	-	-	-	0	66		2	2					2					3	2	1	
25	*Оптоелектронні інформаційні системи*	МЕ	0	0	4.0	120	54	36	-	18	-	-	-	0	66		2	2					2					3	2	1	
26	*Фізичні основи електронного матеріалознавства*	МЕ	0	0	4.0	120	54	36	-	18	-	-	-	0	66		2	2					2					3	2	1	
Разом вибіркових ОК циклу професійної підготовки					23	690	324	180	0	144	0	0	0	0	366	3	2	5	0	0	3	0	2	0	0	0	0	18	10	8	0
ВСЬОГО ВИБІРКОВИХ					23	690	324	180	0	144	0	0	0	0	366	3	2	5	0	0	3	0	2	0	0	0	0	18	10	8	0
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ:					62	1860	918	450	0	432	0	36	0	0	942	6	10	13	0	1	4	2	4	26	12	12	2	25	13	12	0

Кількість															
Кількість екзаменів	6	3			3										
Кількість заліків	10		5			5									
МКР	13			6			7								
Курсових робіт	0														
Курсових проєктів	1	1													
РГР, РР, ГР	4		1			3									
ДКР	2			2											
Рефератів	4				2			2							

Ухвалено на засіданні Вченої ради ФЕЛ ПРОТОКОЛ № 05/2024 від 2024-05-20

Завідувач кафедри МЕ _____ Дмитро ТАТАРЧУК
(підпис)

Декан факультету (директор інституту) _____ Валерій ЖУЙКОВ
(підпис)

Примітка: РНП є частиною навчального плану і формується на основі аналізу сукупності індивідуальних навчальних планів здобувачів вищої освіти на поточний навчальний рік;